

ダイジェストカタログ 2020年度

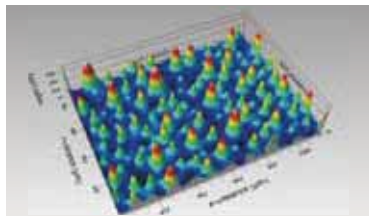
フィルメトリクス株式会社では、長年に亘り光学式膜厚測定装置を販売し、国内の大学・官公庁をはじめとする研究機関や、半導体・化学材料・医療・自動車関連等様々な企業で御使用頂いております。

3次元表面形状測定システム

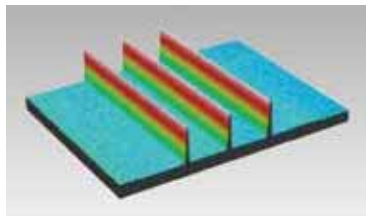
表面形状・段差・粗さ測定システムを身近に！

1台でナノオーダーの表面粗さからミリオオーダーの形状段差測定まで可能です。

段差測定範囲	～ 10 mm
段差測定正確性	0.7%
XY 分解能	最小 0.4 μ m
測定ステージ	100×100 mm 200×200 mm



ポリマー混合物の3次元形状



導波路型回折格子

Profilm3D

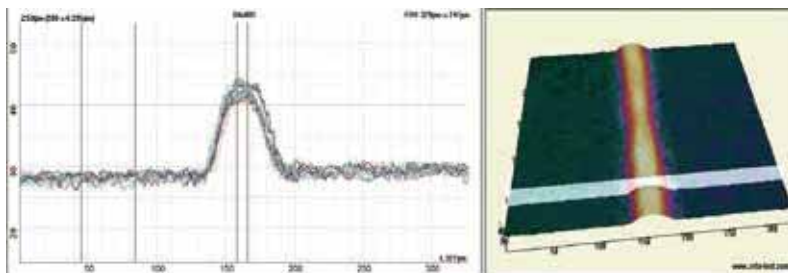
FILMETRICS
A KLA Company



マルチ共焦点顕微鏡システム

独自の ZDot™ テクノロジーで高速測定！

非接触で段差・粗さ・寸法の測定結果を True Color 画像で表示します。デュアル光源を搭載し、高反射率部と低反射率部を同時に測定できます。



太陽電池サンプル

反射率が95%の銀電極部と、1%以下の黒いセル部を同時に測定

Zeta-20

KLA+
INSTRUMENTS



膜厚測定システム

F20

世界中で 5000 台以上使用されているベーシックモデルのアカデミック版です。

FILMETRICS
IIIIII A KLA Company



F20e

- 膜厚測定範囲 15nm ~ 70 μ m

F20e-UV

- 膜厚測定範囲 1nm ~ 40 μ m

F20e-UVX

- 膜厚測定範囲 1nm ~ 250 μ m

アカデミック版 共通仕様

サンプル測定を実施しております。
御見積書・御購入の前に、測定可否、装置仕様のご確認をお願いいたします。

- ① 正確性 膜厚の $\pm 0.2\%$ 、もしくは1nm (F20e-UV もしくは UVX) / 2nm(F20e) のいずれか大きい値
(注) 当社が提供する Si 基板上の SiO₂ 膜を測定した場合の機器本体の正確性
- ② 光学定数解析で使用できる解析モデルは Cauchy のみ
- ③ 現地取り扱い費用は別途必要

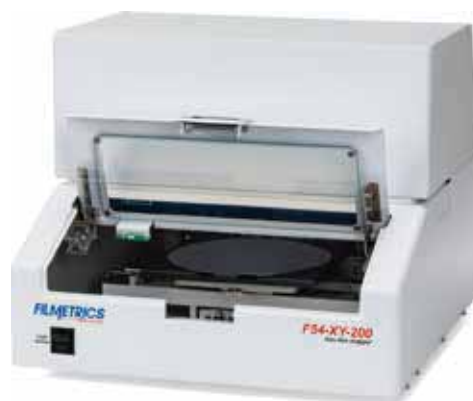
顕微鏡式自動マッピング膜厚測定システム

F54-XY

フォーカス、XYの移動、ベースラインを全て自動化。

サンプルを置くだけで膜厚分布が測定できます。

FILMETRICS
IIIIII A KLA Company



F54-XY-200

- 膜厚測定範囲 20nm ~ 40 μ m
(5倍対物レンズ)
- XY自動ステージ 200mm × 200mm
- 高速測定 25ポイント/14秒

サンプル測定のご案内

- ※ 測定膜厚範囲は、膜材料など、サンプルの条件によって異なります。
- ※ サンプル測定を実施しております。御見積書・御購入の前に、測定可否、装置仕様のご確認をお願いいたします。

FILMETRICS
IIIIII A KLA Company

フィルメトリクス株式会社

〒222-0033 横浜市港北区2-5-9 新横浜フジカビル Tel : 045-473-7109

Email: info@filmmetrics.co.jp URL: www.filmmetrics.co.jp